

Настоящее изобретение относится к оптической системе 2 для наблюдения высокотемпературных объектов. Система обеспечивает проецирование электромагнитного излучения 26 на поверхность детали и обнаружение дефектов детали. При определенной длине волны и частоте модуляции излучения возможно наблюдение характеристик 30 контролируемой поверхности без помех, вызванных фоновым излучением.